

SiGe MEMS の拠点

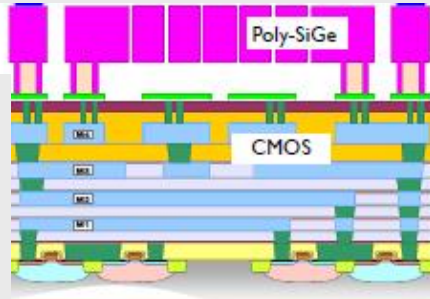
IMEC: HOME OF SIGE MEMS

Background

In imec's 200mm fab a dedicated **poly-SiGe above-IC MEMS** (Micro Electro-Mechanical Systems) IMEC では、ポリ SiGe による MEMS と、読出回路や駆動回路を同一チップに集積化する、**IC 上ポリ SiGeMEMS** プラットフォームを、200mm ウェハ用ファブで準備しました。このモノリシックによる集積化 MEMS は、小形化、組立・実装の低コスト化および高性能化で、現在のハイブリッドによる方

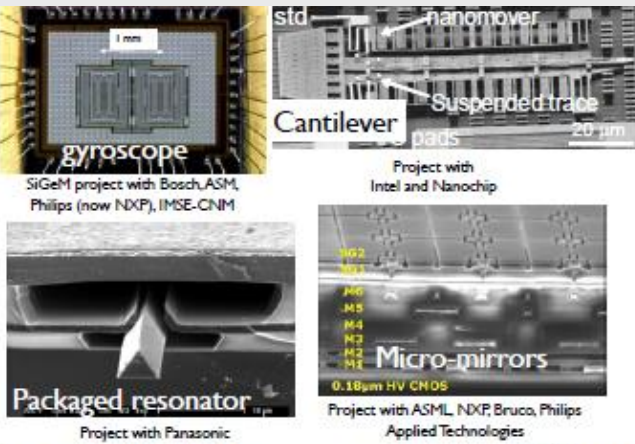
Platform

The **SiGe MEMS platform** consists of a number of この **SiGeMEMS のプラットフォーム**は、CMOS 保護層、MEMS への接続部と SiGe 電極、SiGe 構造層、さらにはポリ SiGe による薄膜パッケージ構造など、いくつかの標準モジュールから成ります(右図)。これに加えてピエゾ抵抗の機能を追加することも可能です。



Demonstrators

With this platform and together with our partners several **successful** demonstrators have been developed. このプラットフォームで、左図のような SiGe による MEMS デバイスを、共同研究機関と一緒に開発してきました。これには自動車に応用できる集積化ジャイロスコープ、高度産業機械用の 2 百万個の可動鏡を配列した高信頼性ミラーアレイ、マルチプローブデータ記録装置のため片持梁アレイ、SiGe 薄膜パッケ



This SiGe platform, together with the technologies that imec offers to industrial customers through our **CMORE service**. Within CMORE innovative concepts are turned into products. Academic customers can make use of the SiGe **MPW service** within **Europractice** (exhibit #4)

この SiGe プラットフォームは IMEC が産業界の皆様へ我々の **CMORE サービス**を通して提供できる技術の一つです。CMORE によって革新的なコンセプトを製品にすることができます。大学・研究機関の皆様へ